





Fabricage van nanofotonische structuren met gefocusseerde ionenbundels

publieke verdediging Jonathan Schrauwen

Promotor: Prof. Dries Van Thourhout

Vakgroep Informatietechnologie Faculteit Ingenieurswetenschappen

4 februari 2009

Licht





Golven of deeltjes?

 $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 4\pi k\rho$ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ $\nabla \mathbf{x} \, \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ $\nabla \mathbf{x} \, \vec{B} = \frac{\vec{J}}{\varepsilon_0 c^2} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$





3





UNIVERSITEIT Nanofotonisch?



UNIVERSITEIT Nanofotonisch?

Lichtbreking



verschil in brekingsindex (Δn) **†**



UNIVERSITEIT Nanofotonisch?



Nanofotonisch?

UNIVERSITEIT

Lichtgeleiding in vezels en chips







Communicatie over vezel

00101010101001000111111010000

50 Mbps I DVD per 15 min afstand 100 m

10 Gbps I DVD per 5 sec afstand 100 km



00101010101001000111111010000

>10 Tbps = 1000 Gbps >1000 DVDs per 5 sec afstand 100 km

multiplexing

00101010101001000111111010000

00101010101001000111111010000

00101010101001000111111010000

00101010101001000111111010000

GEN1

Nanofotonisch? UNIVERSITEIT



Nanofotonische structuren?





Twee componenten in meer detail:

Roosterkoppelaar



Ringresonator





Roosterkoppelaar



Roosterkoppelaar







Roosterkoppelaar 600 nm **Silicium** 70 nm Oxide







Ringresonatoren zijn filters





Golflengte (de)multiplexing







Gevoelig voor nanometers



UNIVERSITEIT GENT

17

Nanofotonisch?





18

UNIVERSITEIT Nanofotonisch? Ionenbundels

Fabricage: optische lithografie







193 nm diep-UV lithografie
(gebruikt voor Pentium4 processoren)



Fabricage: imprint lithografie



- Optische / imprint lithografie = kopiëren
 - Paralelle techniek: vele structuren tegelijk
 - Goedkoop voor grote volumes, duur voor kleine volumes
- Seriële technieken:
 - voor maskers en stempels
 - voor prototypes





Gefocusseerde ionenbundels



Gefocusseerde ionenbundels







Gefocusseerde ionenbundels









Optische verliezen









Gas versterkt etsen

- Jodium gas (dijood)
- Versneld etsproces
- Minder ionen = minder schade









Wat is er aan de hand?







Gewone roosterkoppelaar



Even goed als bestaande technieken!

UNIVERSITEIT

GENT

34

Koppelefficientie (dB) -6.0 dB = 25 % -6 Gemaakt met -8 optische lithografie -10 -12 Gemaakt met FIB -14 -16 -18 -20 1500 1480 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660

Golflengte (µm)





Schuine roosterkoppelaar



UNIVERSITEIT

GENT









Verticale koppeling?







FIB schrijven stempel + imprint





Schrauwen et al. US Patent Pending (2008)









Ringresonatoren zijn sensoren











Ringresonatoren zijn sensoren





Ringen met sleuf zijn gevoeliger







Sleuven gemaakt met FIB





Schrauwen et al. IEEE Photonics Technology Letters, vol. 20(23), p.2004 (2008)

UNIVERSITEIT GENT

















































Fabricage van nanofotonische structuren met gefocusseerde ionenbundels

publieke verdediging Jonathan Schrauwen

Promotor: Prof. Dries Van Thourhout

Vakgroep Informatietechnologie Faculteit Ingenieurswetenschappen

4 februari 2009





















UNIVERSITEIT Nanofotonisch?